



校正機関
認定証

COPY

認定番号 RCL00590

機 関 名 称 : 株式会社エビデント
顕微鏡校正ラボトリ

所 在 地 : 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたので、ここに校正機関として認定します。

適 用 基 準 : JIS Q 17025:2018 (ISO/IEC 17025:2017)

認 定 範 囲 : 幾何学量 (附属書による。)

事 業 所 : 附属書による。

有 効 期 限 : 2027 年 4 月 30 日

初回認定日 2023 年 4 月 4 日

公益財団法人
日本適合性認定協会

理事長

飯塚悦功

飯塚悦功



COPY

認定番号

RCL00590

認定証 附属書

(1/3 頁)

試験所・校正機関の別	校正機関
機関名称	株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボラトリ
機関所在地	東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス

1) 校正を実施する事業所

事業所名称	株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボラトリ 本社	
同 所在地	〒	163-0910
	住所	東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス
恒久的施設で行う校正か、 現地校正かの別	<input type="checkbox"/> 恒久的施設で行う校正 <input checked="" type="checkbox"/> 現地校正	

認定範囲

分類コード 測定対象量/ 校正品目	校正範囲	拡張不確かさ ¹⁾	校正手順 書・備考
M13.22 三次元測定機 M13.22.4 デジタルマイクروسコ ープ 器差	XY 平面について 10000 μm 以内 (視野サイズ) 校正対象の対物レンズの種類： 1× 1.25× 2.5× 3× 5× 10× 20× 40× 50×	2.9 %	K-OIS Z12020 (所内手順書) 校正対象機種 は DSX シリ ーズとする。
M13.22 三次元測定機 M13.22.5 レーザ顕微鏡 器差	XY 平面について 961.5 μm 以内 (視野サイズの中心 75 %領域) 校正対象の対物レンズの種類： 10× 20× 50× 100× Z 軸について 1 μm 以内	1.0 % 0.11 μm	K-OIS Z12010 (所内手順書) 校正対象機種 は OLS シリ ーズとする。



COPY

認定番号

RCL00590

認定証 附属書

(2/3 頁)

試験所・校正機関の別	校正機関
機関名称	株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボトリ
機関所在地	東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス

分類コード 測定対象量/ 校正品目	校正範囲	拡張不確かさ ¹⁾	校正手順 書・備考
	観察視野を平面方向に貼り合わせた合成画像における X、Y 軸について 10000 μm 以内 観察視野を平面方向に貼り合わせた合成画像における Z 軸について 300 μm 以内	対物レンズ 10 \times : 18 μm 対物レンズ 20 \times : 9.4 μm 1.9 μm	
1) 包含係数に関する情報	<input checked="" type="checkbox"/> 信頼の水準約 95 %, $k=2$ <input type="checkbox"/> t 分布に基づき求めた有効自由度に応じた包含係数であり、95 % の信頼の水準をもつと推定される区間を与える。 <input type="checkbox"/> その他 ()		

COPY

認定番号

RCL00590

認定証 附属書

(3/3 頁)

試験所・校正機関の別	校正機関
機関名称	株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボトリ
機関所在地	東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス

2) 1)以外の事業所で主たる活動を行う事業所

事業所名称	株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボトリ 大阪支店	
同 所在地	〒	530-6031
	住所	大阪府大阪市北区天満橋 1-8-30 OAP タワー 31 階

3) 1)以外の事業所で主たる活動を行う事業所

事業所名称	株式会社エビデント 顕微鏡校正ラボトリ 八王子事業場	
同 所在地	〒	192-0033
	住所	東京都八王子市高倉町 67-4

公益財団法人
日本適合性認定協会